

クリエイティブミニマルファブ施設(CMF)装置リスト

装置番号	施設(装置)名称	装置分類	設置部屋	資産番号	備考
CMF-001	ミニマル装置 マスクレス露光	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA4332	
CMF-002	ミニマル装置 電子ビームリソグラフィ(EB露光)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA5358	
CMF-003	ミニマル装置 RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-1	
CMF-004	ミニマル装置 RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-2	
CMF-005	ミニマル装置 コータ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-3	
CMF-006	ミニマル装置 デベロッパ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-4	
CMF-007	ミニマル装置 SOD(P)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-5	
CMF-008	ミニマル装置 SOD(B)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-6	
CMF-009	ミニマル装置 拡散炉(B)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-7	
CMF-010	ミニマル装置 拡散炉(P)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-8	
CMF-011	ミニマル装置 イオン注入(P)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-9	
CMF-012	ミニマル装置 イオン注入(B)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-10	
CMF-013	ミニマル装置 PE-CVD(SiN)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-11	
CMF-014	ミニマル装置 スパッタ(Pt)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-12	
CMF-015	ミニマル装置 スパッタ(Au)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-13	
CMF-016	ミニマル装置 スパッタ(TiN)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-14	
CMF-017	ミニマル装置 スパッタ(Cr)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-15	
CMF-018	ミニマル装置 スパッタ(3元)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-16	
CMF-019	ミニマル装置 スパッタ(汎用)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-17	

CMF-020	ミニマル装置 マルチターゲットスパッタ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-18	
CMF-021	ミニマル装置 CMP	前処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-19	
CMF-022	ミニマル装置 マイクロプラズマエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-20	
CMF-023	ミニマル装置 マルチボンダ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-21	
CMF-024	ミニマル装置 干渉膜厚計	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-22	
CMF-025	ミニマル装置 金属膜厚計	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-23	
CMF-026	ミニマル装置 微粒子スキャナ	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-24	
CMF-027	ミニマル装置 デバイステスタ	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	18AA6635-25	
CMF-028	ミニマル装置 RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6583	
CMF-029	ミニマル装置 Piranha Clean洗浄	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6589	
CMF-030	ミニマル装置 ウェットエッチャ(AI)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6599	
CMF-031	ミニマル装置 ウェットエッチャ(SiO2)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6600	
CMF-032	ミニマル装置 ウェハ反転	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6601	
CMF-033	ミニマル装置 コータ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6602	
CMF-034	ミニマル装置 デベロッパ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6604	
CMF-035	ミニマル装置 マスクアライナ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6605	
CMF-036	ミニマル装置 集光加熱炉	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6606	
CMF-037	ミニマル装置 酸化炉	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6608	
CMF-038	ミニマル装置 レーザ加熱	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6610	
CMF-039	ミニマル装置 スパッタ(AI)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6611	
CMF-040	ミニマル装置 スパッタ(TiN)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6612	

CMF-041	ミニマル装置 TEOSプラズマCVD	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6632	
CMF-042	ミニマル装置 深掘エッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6638	
CMF-043	ミニマル装置 メタルエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6640	
CMF-044	ミニマル装置 ダイボンド	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6641	
CMF-045	ミニマル装置 圧縮モールド	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6669	
CMF-046	ミニマル装置 レーザーアブレーション	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6670	
CMF-047	ミニマル装置 スパッタ(Ti)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6671	名称を実体に合わせて変更 (Cu→Ti)(2025/1)
CMF-048	ミニマル装置 Cuメッキ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6673	
CMF-049	ミニマル装置 ウェットエッチャ(Cu)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6674	
CMF-050	ミニマル装置 アセトン洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6676	
CMF-051	ミニマル装置 ボールマウンタ	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6677	
CMF-052	ミニマル装置 リフロー炉	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6678	
CMF-053	ミニマル装置 プラズマクリーナ(デスミア加工)	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6679	
CMF-054	ミニマル装置 スパッタ(Cu)	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-055	ミニマル装置 集光加熱炉	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-056	ミニマル装置 RCA洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-057	ミニマル装置 レジスト除去	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-058	ミニマル装置 Piranha洗浄	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-059	ミニマル装置 マスクレス露光	処理	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	消耗品	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/7)
CMF-060	ミニマル装置 マイクロプラズマエッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	24AB0840	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2024/12)
CMF-061	ミニマル装置 深掘エッチャ	処理／加工	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	24AB7251	ミニマルファブ推進機構から 寄附(2025/3)

CMF-101	電界放出型走査型電子顕微鏡	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042040	18AA8644	
CMF-102	光学顕微鏡	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6682	
CMF-103	触針式プロファイリングシステム	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042040	17AA6687	
CMF-104	電気特性分析用プローバ	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6714	
CMF-105	半導体パラメータ・アナライザ	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6715	
CMF-106	LCRメータ	評価	臨海副都心センター第二別館 サイバーフィジカルシステム研究棟 042020	17AA6716	